08

Влияние случайного потенциала на оптические свойства полупроводниковых CdS_xSe_{1-x} нанокристаллов

© Д.М. Седракян, П.Г. Петросян, Л.Н. Григорян

Ереванский государственный университет, 0025 Ереван, Армения e-mail:ppetros@ysu.am

(Поступило в Редакцию 13 марта 2014 г.)

Получены полупроводниковые нанокристаллы CdS_xSe_{1-x} в силикатном стекле с разной степенью совершенства кристаллической решетки. Показано, что наблюдаемые особенности в спектрах оптического пропускания и фотолюминесценции в начальном этапе термообработки невозможно объяснить только диффузионным ростом нанокристаллов. Необходимо учитывать, что в начальной стадии образоваания нанокристаллов в них существует структурные дефекты.

Введение

В последнее время в физике полупроводников развивается новая область, где исследуются оптические и электрические свойства мельчайших полупроводниковых кристаллов, размеры которых составляют несколько нанометров [1–3]. Особый интерес представляют полупроводниковые нанокристаллы в силикатном стекле, поскольку они уже нашли свое применение в оптоэлектронных устройствах [4–6].

По сравнению с объемными полупроводниками в нанокристаллах ограничивается движение электрона, что приводит к квантованию энергии. Возникают дискретные энергетические уровни, местоположение которых сильно зависит от размера и формы нанокристалла [7,8]. При вычислении энергетического спектра обычно учитывается распределение периодического потенциала и рассматриваются ограничения движения экситона в периодическом поле. Однако, как показывают исследования проведенные электронным микроскопом [9-11], в начальной стадии зародышеобразования в нанокристаллах присутствует несовершенная кристаллическая решетка. Таким образом, в нанокристалле существуют как периодический, так и случайно изменяющийся потенциал, который также дает вклад в формирование зонной структуры. Влияние случайного потенциала на зонную структуру, а следовательно, на оптические свойства полупроводниковых нанокристаллов на наш взгляд представляет практический и научный интерес.

В настоящей работе исследуется влияние случайного потенциала на оптические свойства полупроводниковых нанокристаллов CdS_xSe_{1-x} в силикатном стекле.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Нанокристаллы CdS_xSe_{1-x} в силикатном стекле были получены по технологии, описанной в работе [12]. Образцы отличались друг от друга средними размерами нанокристаллов. Выращивание полупроводниковых нанокристаллов разных размеров и разной степени совершенства кристаллической решетки осуществлялось путем установления температуры и времени последующей термообработки силикатного стекла. Термообработка образцов происходила в программно-управляемой печи при температуре 530°С. Данная температура термообработки достигалась в течение одного часа, после чего образцы оставались при данной температуре. Отжиг стекол приводил к их окрашиванию в цвет от светложелтого до темно-красного.

Спектры пропускания и фотолюминесценции исследовались в диапазоне 300–900 nm с помощью спектрометров USB-4000 (Ocean optics Inc.) и Cary Eclipse fluorescence spectrometer.

На рис. 1 приведены спектры пропускания образцов, измеренные до и после проведения различ-



Рис. 1. Спектры пропускания силикатных стекол, содержащих полупроводниковые CdS_xSe_{1-x} нанокристаллы (образец T_1 — без термообработки, образцы T_2, T_3, \ldots, T_8 отжигались при 530°C соответственно $t_2 = 5 \text{ min}, t_3 = 15 \text{ min}, t_4 = 35 \text{ min}, t_5 = 65 \text{ min}, t_6 = 125 \text{ min}, t_7 = 245 \text{ min}, t_8 = 425 \text{ min}).$



Рис. 2. Зависимость $K = f(h\nu)^2$ от энергии подающего фотона для образца T_6 .

ных по длительности термообработок в воздушной среде (образец T1 — без термообработки, образцы *T*₂, *T*₃,..., *T*₈ отжигались при 530°C соответственно $t_2 = 5 \min, t_3 = 15 \min, t_4 = 35 \min, t_5 = 65 \min, t_6 =$ $= 125 \min, t_7 = 245 \min, t_8 = 425 \min)$. Как видно, термообработка приводит к образованию резкого края поглощения, и происходит сдвиг края поглощения в сторону длинных волн. Дополнительная термообработка вызывает также изменение прозрачности образцов в области пропускания. Сначала она увеличивается, а потом уменьшается. Изменение формы спектра пропускания и сдвиг края обусловлены образованием нанокристаллов и их дальнейшим диффузионным ростом [13]. С помощью спектров пропускания можно определить средний размер полупроводниковых нанокристаллов. Из полученных спектров пропускания вычислялась спектральная зависимость коэффициента поглощения K = K(hv). Экспериментально установлено, что в диапазоне 350-700 nm отражение незначительное (менее 4%), и поэтому при определении K = K(hv) отражение можно не учитывать.

Так как полупроводниковое соединение CdS_xSe_{1-x} имеет прямозонную структуру, то спектральная зависимость коэффициента поглощения определяется следующим выражением [14]:

$$K = \frac{A}{h\nu} \left(h\nu - E_g \right)^{1/2},\tag{1}$$

где A = const, которая зависит от эффективных масс электронов и дырок, hv — энергия падающего света, E_g — энергия ширины запрещенной зоны. На рис. 2 приведен пример зависимости $K = f (hv)^2$ от энергии падающего фотона. Исследование спектров поглощения показывают, что спектры имеют экспоненциальный участок при $hv < E_g$, а при $hv > E_g$ наблюдается корневая зависимость. Пересечение прямолинейного участка зависимости $K = f (hv)^2$ от hv с осью абсцисс дает возможность определить величину $hv_{0.1}$, которая соответствует переходам между первыми энергетическими уровнями для электронов и дырок, возникших из-за квантового размерного эффекта. В случае сферических квантовых точек, когда их размеры меньше или соизмеримы с радиусом экситона, величина $hv_{0.1}$ определяется формулой [15]

$$h\nu_{0.1} = E_{g0} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2\mu R^2},\tag{2}$$

где E_{g0} — ширина запрещенной зоны массивного образца, $\mu = \frac{m_n m_p}{m_n + m_p}$, *R* — средний радиус квантовой точки. С помощью выражения (2) были определены средние радиусы нанокристаллов в образцах, отличающихся друг от друга длительностью термообработки. При определении среднего радиуса нанокристаллов необходимо знать E_{g0} , которая зависит от величины x в соединении CdS_xSe_{1-x} . Хорошо известно, что в процессе фазового распада можно выделить три стадии — зародышеобразование, диффузионный рост и коалесценция, которая является завершающей стадией процесса, когда кристаллы больших размеров увеличиваются за счет поглощения маленьких [16,17]. С увеличением длительности термообработки в конечном счете можно получить кристаллы с такими размерами, в которых можно пренебречь эффектом размерного квантования. В таких образцах энергия ширины запрещенной зоны стремится к Eg0. Экспериментально показано, что после длительной термообработки энергия ширины запрещенной зоны стремится к значению 2 eV.

Ширина области корневой зависимости коэффициента поглощения обусловлена параболичностью зависимости энергии носителей заряда от волнового вектора E(k). Чем больше размеры нанокристаллов, тем ближе его энергетический спектр к спектру массивного образца CdS_xSe_{1-x} , а это означает, что с ростом размеров нанокристаллов ширина области корневой зависимости должна увеличиваться. Ширина области корневой зависимости *m* определяется как $m = hv_0 - hv_\Delta$, где hv_Δ — энергия, начиная с которой наблюдается корневая зависимость, а hv_0 — максимальная энергия фотона, начиная



Рис. 3. Зависимость ширины области корневой зависимости от размеров нанокристаллов.



Рис. 4. Зависимость области Δ от времени термообработки.

с которой корневая зависимость исчезает. На рис. 3 показана зависимость ширины области корневой зависимости от размеров нанокристаллов. Как видно, ожидаемый рост происходит до определеного размера нанокристаллов, после чего ширина области корневой зависимости уменьшается. Отметим, что это уменьшение происходит тогда, когда начинает уменьшаться прозрачность образцов в области пропускания.

Наблюдается отклонение от корневой зависимости K = f(hv) и в области низких частот. В зависимости от времени термообработки область Δ ($\Delta = h v_{\Delta} - E_g$, где hv_{Δ} — энергия фотона, соответствующая выходу кривой $K = f(hv)^2 = f(hv)$ на прямолинейный участок), характеризующая величину этого отклонения, уменьшается (рис. 4). В полупроводниках экспоненциальная зависимость коэффициента поглощения при энергиях $hv < E_g$ обусловлена нарушением периодичности потенциала кристаллической решетки. Величина Д, которая характеризует степень размытости края поглощения, в нашем случае может быть обусловлена как дисперсией радиуса нанокристаллов, так и наличием в ней точечных дефектов [18]. Уменьшение величины Δ на начальном этапе термообработки свидетельствует о том, что в процессе термообработки увеличивается степень идеальности кристаллической решетки.

Структурные изменения, происходящие в нанокристаллах, должны проявляться также в спектрах фотолюминесценции. Нами были исследованы спектры фотолюминесценции образцов, которые отличались друг от друга длительностью дополнительной термооброботки при 530°С. Для измерения спектра фотолюминесценции



Рис. 5. Спектры фотолюминесценции силикатных стекол с нанокристаллами CdS_xSe_{1-x} (*a* — до термообработки, *b*, *c*, *d* — после термообработки) при 530°C соответственно 5, 35, 125 425 min.



Рис. 6. Зависимость максимальной интенсивности фотолюминесценции от среднего размера нанокристаллов.

в диапазоне 300-900 nm накачка осуществлялась с помощью ртутной лампы (250 nm).

На рис. 5 приведены спектры фотолюминесценции силикатных стекол с нанокристаллами CdS_xSe_{1-x} , при различных мощностях возбуждающего излучения. Мощность излучения регулировалась с помощью напряжения питания ртутной лампы. Как видно из полученных спектров, в начальном этапе термообработки фотолюминесценция слабая, что можно объяснить тем, что в начальном этапе термообработки совершенная кристаллическая решетка не образована и в таких условиях рекомбинация безызлучательная. С увеличением длительности термообработки интенсивность фотолюминесценции сначала увеличивается, а потом уменьшается. На рис. 6 приведена зависимость максимальной интенсивности фотолюминесценции от среднего размера нанокристаллов при напряжении 750 V питания ртутной лампы. Как край поглощения, так и край в спектре фотолюминесценции, которые соответствуют рекомбинации носителей заряда на нижние энергетические уровни или между мелкими ловушками, с увеличением времени термообработки смещаются в длинноволновую область спектра. Излучение в спектрах фотолюминесценции при длинах волны больших, чем длина волны, соответствующей краю поглощения, обусловлено рекомбинацией носителей заряда, захваченных на ловушках [19]. Ловушки локализованы на границе раздела полупроводник-силикатное стекло или на поверхности полупроводника. Поверхностные ловушки могут быть связаны с вакансиями Cd²⁺, S²⁻, Se²⁻ свободными связами или адсорбированными атомами кислорода на поверхности полупроводника.

Уменьшение прозрачности в области пропускания, ширины корневой зависимости, а также максимального значения интенсивности люминесценции в образцах с большими размерами нанокристаллов, по всей вероятности, обусловлено тем, что в процесе многократной термообработки одного и того же образца на границе раздела полупроводник—матрица или на повехности полупроводника возникают новые дефекты. Для обоснования этого предположения требуются дополнительные исследования, что нами планируется осуществить в дальнейшем.

На рис. 7 приведена зависимость среднего размера нанокристаллов от времени термообработки при 530°С. Средний радиус нанокристаллов определялся в приближении, что зоны электронов и дырок имеют параболическую форму и не учитывается взаимодействие электрона и дырки, по формуле (2). Известно, что после образования зародышей нанокристаллов происходит их диффузионный рост. В процессе диффузионного роста зависимость среднего радиуса от времени термообработки выражается формулой [11,17]

$$R(t) = R_0 + \sqrt{2D \frac{C_0 - C_e}{C_p - C_e}} t,$$
(3)

где C_0 — концентрация полупроводниковой фазы в матрице в начале процесса, C_e — равновесная концентрация полупроводниковой фазы в матрице, C_p — концентрация полупроводника в нанокристалле, D — эффективный коффициент диффузии. Экспериментально полученная зависимость среднего радиуса нанокристаллов от времени термообработки была аппроксимирована $R(t) = R_0 + k\sqrt{t}$ формулой, и для R_0 и k были получены следующие величины: $R_0 = 18.3$ Å, k = 0.5 Å/min^{1/2}. Как видно из рис. 6, корневая зависимость наблюдается при t > 50 min. Резкий рост размеров нанокристаллов на начальном этапе термообработки невозможно объяснить процессом диффузии.

В работе [20] рассмотрена задача нахождения энергии основного состояния квантовой частицы цилиндрической формы, диспергированных в прозрачной диэлектрической матрице. Предполагается, что внутри наноструктуры имеется точечный дефект, который задается в виде δ -потенциала, и была найдена зависимость края поглощения спектра от местонахождения и мощности δ -потенциала. Нанокристалл в диэлектрической матрице



Рис. 7. Зависимость среднего размера нанокристаллов от времени термообработки при 530°С.

представляет собой трехмерную бесконечую потенциальную яму для носителей заряда. В подавляющем числе работ, где определяется энергетический спектр носителей заряда в нанокристаллах, предполагается, что нанокристаллы имеют шарообразную форму. В этом случае определение энергетических уровней сводится к решению стандартной задачи стационарного движения частицы в сферически симметричной прямоугольной яме бесконечной глубины. Край поглощения (если $R \ll a_{\rm B}$, где $a_{\rm B}$ — боровский радиус экситона), который определяется переходами между основными квантовыми уровнями для электронов и дырок, вычисляется формулой (2).

Как показывают исследования, проведенные с помощью электронного микроскопа [21], нанокристаллы CdS_xSe_{1-x} в силикатном стекле имеют не шарообразную форму, а растянуты в одном направлении. С помощью дифракции рентгеновских лучей показано, что частицы CdS_xSe_{1-x} в силикатном стекле имеют гексагональную структуру с постоянными решетки a = 4.16 Å, c = 6.76 Å. Если полагать, что растующие нанокристаллы повторяют форму элементарной ячейки, то можно считать, что они имеют почти цилиндрическую форму с отношением диаметра основания на высоту как a/c. В работе [20] рассчитан энергетический спектр для цилиндрических нанокристаллов и показано, что, если точечный дефект находится на торцевой поверхности цилиндра, то вид энергетического спектра такой, как у образца без дефекта. В этом случае край поглощения определяется выражением

$$h\nu_{0.1} = E_{g0} + \frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\lambda_{10}^2}{r^2} + \frac{\pi^2}{a^2}\right),\tag{4}$$

где $\lambda_{0.1} \approx 2.405$, *г* и *d* — радиус основания и высота цилиндра соответственно.

Используя выражение (4) и зная отношение a/c были определены размеры цилиндрических нанокристаллов. Для сравнения этих размеров с размерами (R), определенными для шарообразных нанокристаллов из выражения (2), вместо цилиндра взяли такого же объема шар радиусом R^* . Как показали расчеты, отношение R/R^* практически не зависит от времени термообработки и близко к единице.

Когда в нанокристалле существует точечный дефект, то выражение (4) принимает следующий вид:

$$hv_{0.1} = E_{g0} + \frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\lambda_{10}^2}{r^2} + \frac{y^2}{d^2}\right),\tag{5}$$

где величина у зависит как от мощности, так и от местонахождения δ -потенциала. Расчеты показывают, что для данной мощности дефекта у принимает максимальную величину, когда дефект находится в центре цилиндра. В соответствии с вышеуказанной теорией была вычислена величина смещения края поглощения, когда в центре цилиндрического нанокристалла находится дефект и когда он отсутствует. Показано, что это смещение для образцов CdS_xSe_{1-x} (r = 17.1 Å, d = 27.8 Å), объем которых равен объему шара с радиусом R = 18.3 Å, может составлять до 0.85 eV.

Для того чтобы объяснить наблюдаемые особенности в спектрах пропускания, предполагается, что в начальной стадии образоваания нанокристаллов в них существуют структурные дефекты. Присутствие этих дефектов проявляется в виде случайного потенциала, который накладывается на периодический потенциал кристаллической решетки. Дальнейшая термообработка приводит к увеличению степени идеальности кристаллической решетки.

Как показывают теоретические расчеты [20], исчезновение дефектов без изменения размеров нанокристаллов может привести к сдвигу края поглощения до 0.85 eV, в нашем эксперименте термообработка до 50 min приводит к смешению края поглощения до 0.3 eV. Такое смещение невозможно объяснить диффузионным ростом нанокристаллов, так как при 530°С коэффициент диффузии в силикатном стекле достаточно маленький.

В работе [22] нами были исследованы спектральные зависимости температурных коэффициентов поглощения *dK/dT* для образцов, которые отличались друг от друга длительностью термообработки при 560°С. В работе [23] теоретически была получена спектральная зависимость коэффициента поглощения для диэлектрической матрицы, содержащей полупроводниковые нанокристаллы с гауссовским распределением по размеру. Имея эту зависимость, была вычислена спектральная зависимость температурного коэффициента поглощения. С помощью сопоставления теоретических и экспериментальных кривых были получены зависимости дисперсии нанокристаллов от времени термообработки (рис. 8). В пользу предположения об увеличении степени совершенства кристаллической решетки при термообработке также говорит зависимость дисперсии нанокристаллов от времени термообработки. Из приведенных на рис. 8 данных следует, что термообработка при 560°C приводит к уменьшению дисперсии в начальном этапе термообработки, после чего происходит насыщение. Похожее



Рис. 8. Зависимости дисперсии нанокристаллов от времени термообработки.

поведение дисперсии наблюдается и при термообработке образцов при 420°С, несмотря на то что при этой температуре изменение размеров нанокристаллов незначительно. Уменьшение дисперсии при низких температурах термообработки также может быть объяснено увеличением совершенности кристаллической решетки. В начальном этапе образования нанокристаллов, когда энергетические уровни "размазаны", край поглощения не может быть резким, и в таких системах поглощение эквивалентно поглощению в системах с большей дисперсией размеров нанокристаллов.

Заключение

Таким образом, получены полупроводниковые нанокристаллы CdS_xSe_{1-x} в силикатном стекле, исследованы их оптические спектры пропускания и фотолюминесценции в зависимости от степени совершенства кристаллической решетки. Показано, что смещение края поглощения в начальной стадии термообработки связано с увеличением степени совершенства кристаллической решетки в нанокристаллах, что потверждают и теоретические расчеты.

Список литературы

- [1] Alferov Zh. // Rev. Mod. Phys., 2001. Vol. 73 (3). P. 767.
- [2] Асрян Л.В., Сурис Р.С. // ФТП. 2004. Т. 38. Вып. 1. С. 3–26.
- [3] Peng X., Manna L., Yang W., Wickham J., Scher E., Kadavanich A., Alivisatos A.P. // Nature. 2000. Vol. 404. P. 59.
- [4] *Masumoto Y., Takagahara T. //* Semiconductor Quantum Dots. Berlin: Springer, 2002.
- [5] Morgan N.Y., Leatherdale C.A., Drndic M., Mirna V. Jarosz, Marc A. Kastner, Bawendi M. // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 66. P. 075 339.
- [6] Бондарь И.В., Гурин В.С., Соловей Н.П., Молочко А.П. // ФТП. 2007. Т. 41. Вып. 8. С. 959–965.
- [7] Ekimov A.I., Efros A.L. // Phys. Stat. Sol. B. 1988. Vol. 150.
 P. 627–631.
- [8] Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: Ком. Книга, 2006.
- [9] Бреховских С.М., Никонов Ю.П., Нейч А.И. // Физика и химия стекла. 1977. Т. З. Вып. 2. С. 172–176.
- [10] Brus L.E. // Nanosttruct. Mater. 1992. Vol. 1. P. 71-81.
- [11] Gyrevich S.A., Ekimov A.L., Kudryavcev I.A, Lublinskaya O.G., Osinski A.B. // Semiconductor. 1994. Vol. 28. P. 830–836.
- [12] Grigoryan L., Petrosyan P., Petrosyan S., Bellani V., Maglia F. // Eur. Phys. J. B. 2003. Vol. 34. P. 415–419.
- [13] Grigoryan L, Petrosyan P, Petrosyan H, Bellani V. // Opt. Commun. 2008. Vol. 281. P. 5838–5841.
- [14] Кулиш Н., Кунец В., Лисица М. // Укр. физ. журн. 1992. Т. 37. Вып. 8. С. 114.
- [15] Kayanuma Y. // Phys. Rev. 1988. Vol. 38. P. 9797.
- [16] Лифшиц И., Слезов В. // ЖЭТФ. 1958. Т. 35. С. 479.
- [17] *Kampman R., Wagner R.* Decomposition of alloys: the early stages. Oxford, 1983.

- [18] Forza A., Selloni A. Tetrahedrally-bonded amorphous semiconductors. NY, London, 1985. P. 271.
- [19] Nemec P., Maly P. // J. Appl. Phys. 2000. Vol. 87. N 7. P. 3342.
- [20] Седракян Д., Бадалян Д., Седракян Л. // Известия НАН Армении, Физика. 2014. Т. 49. Вып. 2. С. 71–81.
- [21] Grigoryan L., Petrosyan P., Petrosyan S., Bellani V, Maglia F. // Eur. Phys. J. B. 2003. Vol. 34. P. 415–419.
- [22] Wei-Yu Wu, Schuiman J.N., Hsu T.Y., Uzi Efron // Appl. Phys. Lett. 1987. Vol. 51. P. 710–712.
- [23] Седракян Д., Петросян П., Григорян Л., Бадалян В. // ЖТФ. 2011. Т. 81.Вып. 11. С. 100–105.